

Xper-WLI

(白光干涉仪)

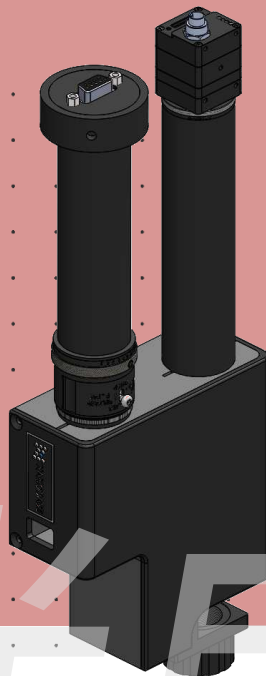
by NANOBASE

纳米尺度的厚度和轮廓检测

WLI和PSI模式两种模式

工业应用：样品和轮廓检测

样品类型：半导体晶圆，纳米器件，生物材料，MEMS:微电子机械系统，LED发光二极管



规格

测量原理
白光干涉原理

CCD分辨率
2464 x 2056 pixels

PSI 滤光片选项
532nm, 633nm (Visible range : 400~750nm)

用途：
表面三维剖面测量，表面粗糙度测量

扫描范围
30 μ m

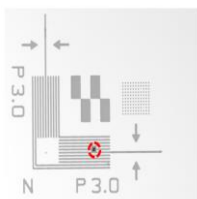
电脑配置
- CPU : Octa Core 3.0 GHz
- RAM : 16 GB
- Storage : SSD 128 GB
- OS : Windows 10

Z轴分辨率
1.75 nm

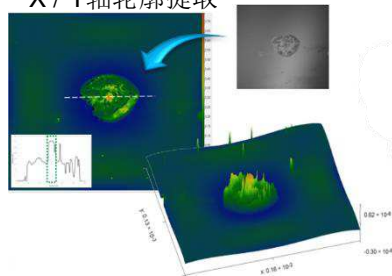
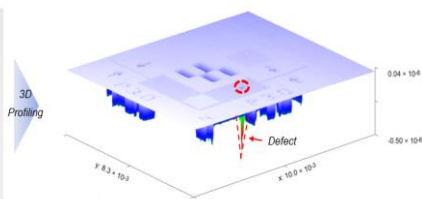
物镜倍率
10x, 20x, 50x, 100x

软件
自动实验条件设置
后期处理：平滑处理/ z轴控制因子设置 /偏移控制
X / Y轴轮廓提取

案例



半导体器件



牙齿细胞成像

联系我们